



光波动场三次元显微镜

MINUK

看清真实，衡量未来。

Features

可评价nm级的透明的异物·缺陷

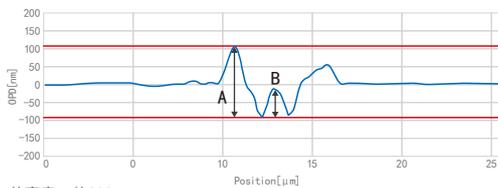
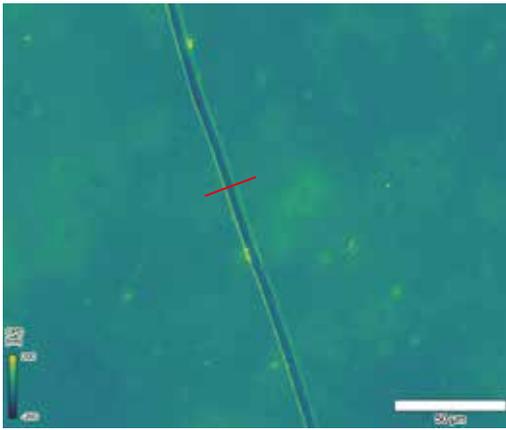
一次拍照即可瞬时获得深度方向的信息

无需对焦，可高速测量

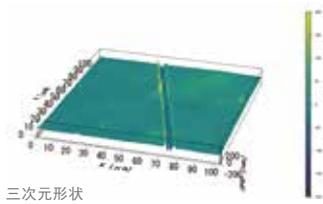
可非破坏·非接触·非侵袭的测量

可轻松在任意的面进行高速扫描决定测量位置

将肉眼无法看见的透明薄膜表面
可视化·量化

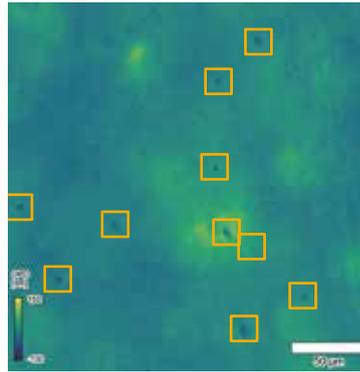


A的高度: 约200nm
B的高度: 约-100nm



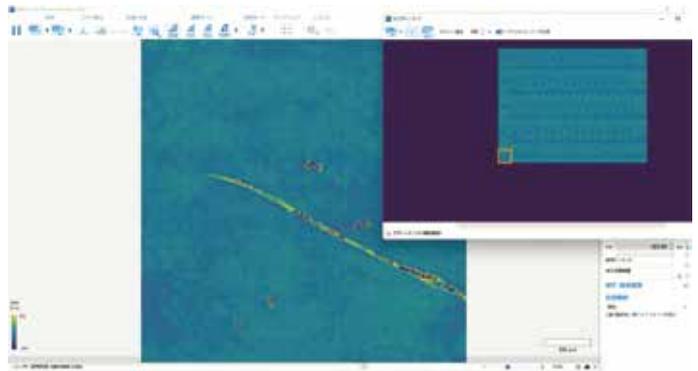
可以非接触、非破坏性、非侵袭性地获得纳米级的形状信息。通过一次拍照即可获取深度方向的信息,可以将透明薄膜表面上肉眼不可见的划痕和缺陷的横截面形状数值化实现可视化。

观察透明薄膜内部的填充物



肉眼无法看到的透明薄膜内部的填充物,通过一次拍照即可观察到。此外,通过在测量后改变深度方向的焦点,可以识别到各个深度的填充物。

高速扫描任意面,确定测量位置



设备的拼接功能可高速广范围的mapping并获取信息,让用户快速找到想要观察的位置并获取详细信息。

分辨率 x, y	691nm(一次拍照)、488nm(合成)
视野 x, y	700×700 μm
分辨率 z	10nm(相位差)
视野 z	±700 μm
样品尺寸	100×80×t20mm(安装通用样品架时)
样品台	微动XY样品台(自动) X: ±10mm Y: ±10mm 粗动样品台 X: 129mm Y: 85mm

激光	波长 638nm 输出 0.39nW 以下 Class1 (对测量样品的照射强度)
尺寸 (长×宽×高)mm	本体: 505(W)×630(D)×439(H) ±20mm ※不含PC、附属品
重量	41kg
功耗	本体: 290VA ※不含PC、附属品

- 所列产品的外观和规格如有更改,恕不另行通知。
- 公司名称及商品名已登录商标。
- 禁止未经授权转载本目录的全部或部分內容。